

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

공개특허번호 1998-077237

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)(51) Int. Cl.
H01L 21/86(11) 공개번호 특1998-077237
(43) 공개일자 1998년 11월 18일(21) 출원번호 특1997-014288
(22) 출원일자 1997년 04월 17일
(71) 출원인 삼성전자 주식회사 원종홍
경기도 수원시 팔달구 매안동 416번지
(72) 발명자 최시영
경기도 수원시 권선구 세류1동 339-8
(74) 대리인 임광선, 정현영, 최재희

심사청구 : 없음

(54) 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법

요약

본 발명은 부여된 납기를 충족시키고 아울러 공정단락을 이룰 수 있도록 하는 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법에 관한 것으로, 본 발명은 호스트 컴퓨터 및 터미널 컴퓨터를 사용한 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법에 있어서, 상기 호스트 컴퓨터를 통해 상기 로트의 대기시간별 우선순위를 설정하는 제 1 설정단계와; 상기 호스트 컴퓨터를 통해 상기 로트의 공정조건별 우선순위를 설정하는 제 2 설정단계와; 상기 대기시간별 및 공정조건별 우선순위에 의한 상기 로트의 목적을 상기 호스트 컴퓨터의 데이터 베이스에 저장하는 저장단계와; 상기 호스트 컴퓨터에 저장된 상기 목적을 상기 터미널 컴퓨터로 다운로드한 후 디스플레이하는 표시단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

이와 같은 본 발명에서는 로트별 작업순서가 소정의 호스트 컴퓨터를 통해 자동으로 관리됨으로써, 체계적인 납기일 관리가 가능하고, 또한 제품의 안정적인 생산을 이룰 수 있다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

- 도 1은 종래의 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법을 순차적으로 도시한 순서도.
도 2는 본 발명에 따른 로트 플로우 제어방법을 구현하기 위한 설비의 배치를 개략적으로 도시한 개념도.
도 3은 본 발명에 따른 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법을 순차적으로 도시한 순서도.
도 4는 본 발명의 제 1 설정단계를 순차적으로 도시한 순서도.
도 5는 본 발명의 제 2 설정단계를 순차적으로 도시한 순서도.
도 6은 본 발명의 제 1 실시예를 순차적으로 도시한 순서도.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예를 순차적으로 도시한 순서도.
도 8은 본 발명의 제 3 실시예를 순차적으로 도시한 순서도.
도 9는 본 발명의 또다른 목적에 따른 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법을 순차적으로 도시한 순서도.
도 10은 본 발명의 제 4 실시예를 순차적으로 도시한 순서도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 제조용 설비의 제어방법에 관한 것으로 좀더 상세하게는 소정의 제어시스템을 구비하여 전체적인 공정부분들(WIP: Work In Process; 이하, WIP라 함함)의 진행정도 및 목표공기를 각 공정 스텝(Step)마다 관리하고 이에 따른 우선순위를 설정함으로써, WIP에 부여된 납기를 충족시키고 아울러 공

공개특허특1898-077237

상기 로트의 공정조건별 원공기를 설정하는 제 1 단계와;

상기 원공기를 산출하여 당해 값이 0 보다 큰가를 판단하는 제 2 단계와;

상기 판단결과, 상기 값이 0 보다 크면 공기별 제 1 순위목록을 작성한 후 디스플레이하는 제 3 단계와;

상기 판단결과, 상기 값이 0 보다 작으면 공기별 제 2 순위목록을 작성한 후 디스플레이하는 제 4 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법.

청구항 15

제 14 항에 있어서, 상기 제 1 단계의 원공기는 하기 식에 의해 설정됨을 특징으로 하는 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법.

현재시간 - {시작시간 + 표준공기}

청구항 16

제 14 항에 있어서, 상기 제 3 단계 또는 상기 제 4 단계 후에 상기 로트 중 당해 스텝에 선 도착한 로트를 판별하는 단계와;

상기 판별결과, 소정의 로트가 선 도착 로트이면 도착순서별 제 1 순위목록을 작성한 후 디스플레이하는 단계와;

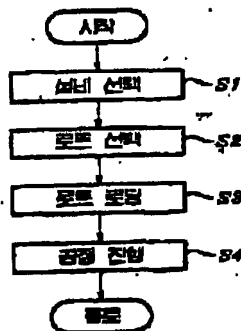
상기 판별결과, 소정의 로트가 후 도착 로트이면 도착순서별 제 2 순위목록을 작성한 후 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법.

청구항 17

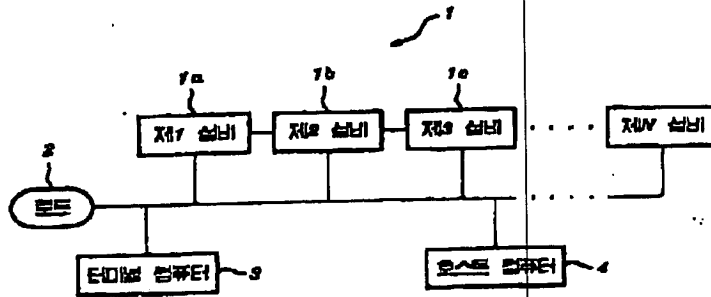
제 16 항에 있어서, 판별대상이 되는 상기 각 로트의 공정조건별 표준공기는 모두 동일함을 특징으로 하는 반도체 제조용 설비의 로트 플로우 제어방법.

도면

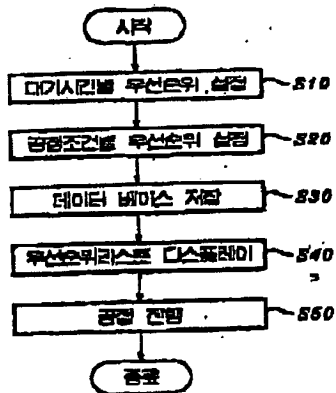
도면1



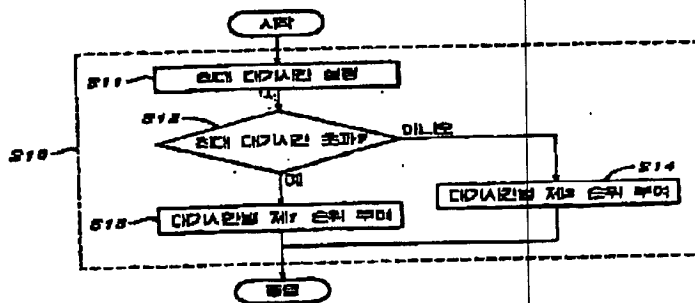
도면2



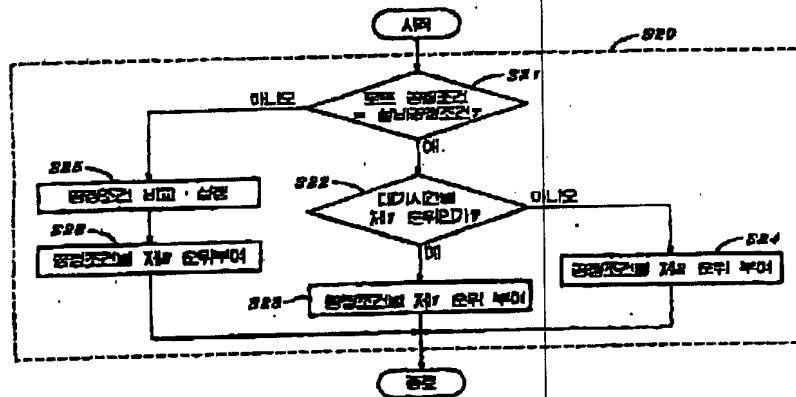
도면3



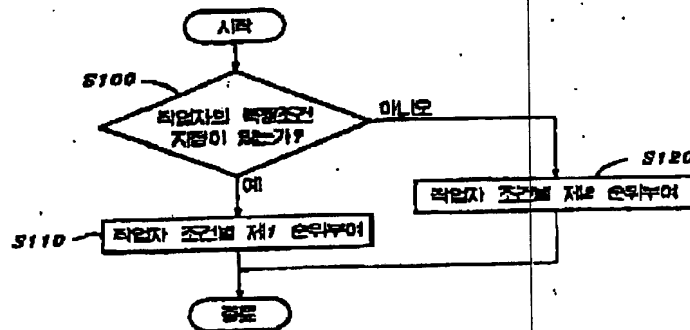
도면4



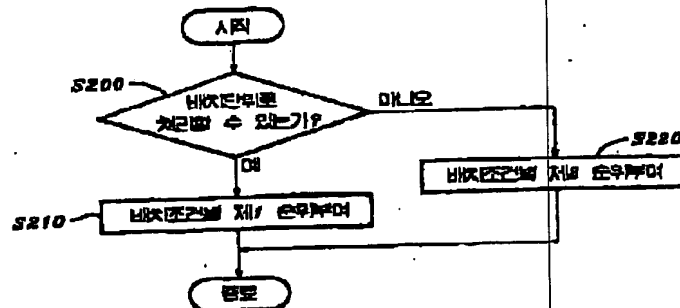
도면5



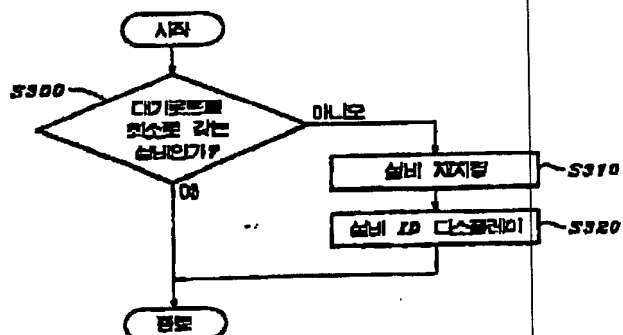
도면6



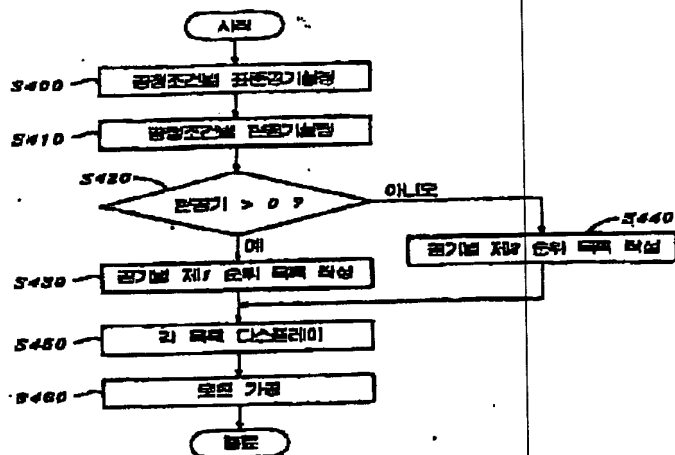
도면7



도면 9



도면 9



도면 10

